**Енишерлова-Вельяшева, Кира Львовна. Физико-технологические основы управления процессами дефектообразования в кремниевых полупроводниковых структурах : диссертация ... доктора технических наук : 05.27.06.- Москва, 1998.- 407 с.: ил. РГБ ОД, 71 99-5/528-0**